



集束イオンビーム・ 走査電子顕微鏡加工観察装置



日本電子製『JIB-4600F』

日本電子製の集束イオンビーム・走査電子顕微鏡加工観察装置は高分解能FE-SEMにFIB集束イオンビームとEDSエネルギー分散型 X線分析装置が装備された複合機です。FIBはガリウムイオンを静電レンズで集束・照射して試料をサブミクロンレベルでの微細加工が可能です。透過型電子顕微鏡用の試料作製等にご利用できます。さらにEDSにより、元素の定性と定量分析も可能になっています。

活用事例

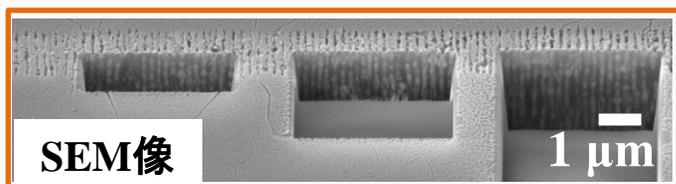


図1 FIBによるガラスの断面加工

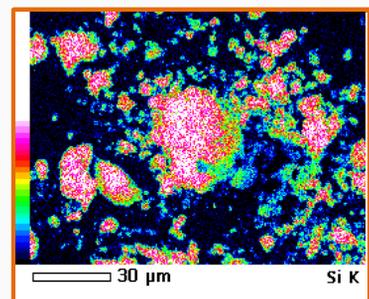


図2 EDSの元素マッピング分析